

マテリアル先端リサーチインフラ (ARIM) 事業共用機器の使用料設定について
(旧ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細加工)分)

令和6年5月1日適用

I 1時間あたりの使用料

単位:円、消費税込み

番号	共用機器種別	データ登録	依頼測定時(技術代行)			直接測定時(技術補助)			直接測定時			(参考) 旧ナノテクノロジー機器 No.
			学内者	学外者		学内者	学外者		学内者	学外者		
				非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人	
NU-201	イオン注入装置	未登録	2,400	7,400	9,400	2,400	5,200	6,900	2,400	3,400	4,900	5
	日新電機社製 NH-20SR-WMH	登録		5,200	6,600		3,700	4,900		2,400	3,500	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	9,200	11,700	---	6,500	8,600	---	4,300	6,200	
NU-202	急速加熱処理装置	未登録	1,800	6,700	7,900	1,800	4,500	5,400	1,800	2,700	3,400	9
	AG Associates社製 Heatpulse610	登録		4,700	5,600		3,200	3,800		1,900	2,400	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	8,700	10,100	---	6,000	7,000	---	3,800	4,600	
NU-204	原子間力顕微鏡	未登録	1,000	5,700	6,800	1,000	3,500	4,300	1,000	1,700	2,300	12
	Bruker社製 AXS Dimension3100	登録		4,000	4,800		2,500	3,100		1,200	1,700	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,900	9,500	---	5,200	6,400	---	3,000	4,000	
NU-205	3元マグネトロンスパッタ装置	未登録	1,500	6,300	7,700	1,500	4,100	5,200	1,500	2,300	3,200	16
	島津製作所製 HSR-522	登録		4,500	5,400		2,900	3,700		1,700	2,300	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	8,700	10,500	---	6,000	7,400	---	3,800	5,000	
NU-206	電子線露光装置	未登録	3,700	8,800	11,500	3,700	6,600	9,000	3,700	4,800	7,000	57
	日本電子社製 JBX6300FS	登録		6,200	8,100		4,700	6,300		3,400	4,900	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	13,500	17,100	---	10,800	14,000	---	8,600	11,600	
NU-207	X線光電子分光装置	未登録	2,300	7,300	8,900	2,300	5,100	6,400	2,300	3,300	4,400	75
	VG社製 ESCALAB250	登録		5,200	6,300		3,600	4,500		2,400	3,100	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	10,200	12,300	---	7,500	9,200	---	5,300	6,800	
NU-208	マスクアライナー式	未登録	2,500	7,700	9,200	2,500	5,500	6,700	2,500	3,700	4,700	41(1)
	(1)Suss MicroTec AG製 MA-6	登録		5,400	6,500		3,900	4,700		2,600	3,300	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	10,500	12,400	---	7,800	9,300	---	5,600	6,900	
NU-209	ICPエッチング装置一式	未登録	10,600	16,900	19,700	10,600	14,700	17,200	10,600	12,900	15,200	51
	サムコ製 RIE-800	登録		11,900	13,800		10,300	12,100		9,100	10,700	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	26,500	30,500	---	23,800	27,400	---	21,600	25,000	
NU-210	ダイシングソー装置	未登録	2,800	7,800	9,100	2,800	5,600	6,600	2,800	3,800	4,600	63
	サムコ製 DAD522	登録		5,500	6,400		4,000	4,700		2,700	3,300	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	11,100	12,900	---	8,400	9,800	---	6,200	7,400	
NU-211	フェムト秒レーザー加工分析システム	未登録	3,800	9,000	11,200	3,800	6,800	8,700	3,800	5,000	6,700	58
	UFL-Hybrid	登録		6,300	7,900		4,800	6,100		3,500	4,700	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	11,000	13,600	---	8,300	10,500	---	6,100	8,100	
NU-213	8元マグネトロンスパッタ装置	未登録	1,600	6,500	8,000	1,600	4,300	5,500	1,600	2,500	3,500	13
		登録		4,600	5,600		3,100	3,900		1,800	2,500	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,900	9,700	---	5,200	6,600	---	3,000	4,200	
NU-214	8元MBE装置	未登録	2,400	7,500	9,100	2,400	5,300	6,600	2,400	3,500	4,600	14
		登録		5,300	6,400		3,800	4,700		2,500	3,300	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	9,200	11,100	---	6,500	8,000	---	4,300	5,600	
NU-215	ECR-SIMSエッチング装置	未登録	1,000	5,800	7,300	1,000	3,600	4,800	1,000	1,800	2,800	15
		登録		4,100	5,200		2,600	3,400		1,300	2,000	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,100	8,900	---	4,400	5,800	---	2,200	3,400	
NU-216	スプレーコーター一式	未登録	1,800	6,900	8,000	1,800	4,700	5,500	1,800	2,900	3,500	42
	サンメイ製 DC110	登録		4,900	5,600		3,300	3,900		2,100	2,500	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	8,400	9,700	---	5,700	6,600	---	3,500	4,200	
NU-218	電気炉	未登録	2,300	7,300	8,700	2,300	5,100	6,200	2,300	3,300	4,200	8
	光洋リンドバーグ社製 MODEL272-2	登録		5,200	6,100		3,600	4,400		2,400	3,000	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	8,900	10,600	---	6,200	7,500	---	4,000	5,100	
NU-219	酸化・拡散炉	未登録	1,700	6,900	8,600	1,700	4,700	6,100	1,700	2,900	4,100	81
	光洋リンドバーグ社製 MODEL270-M100	登録		4,900	6,100		3,300	4,300		2,100	2,900	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	8,400	10,500	---	5,700	7,400	---	3,500	5,000	
NU-220	小型微細形状測定機一式	未登録	1,700	6,800	7,800	1,700	4,600	5,300	1,700	2,800	3,300	49
	小坂研究所製 ET200	登録		4,800	5,500		3,300	3,800		2,000	2,400	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	8,300	9,500	---	5,600	6,400	---	3,400	4,000	

マテリアル先端リサーチインフラ (ARIM) 事業共用機器の使用料設定について
(旧ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細加工)分)

令和6年5月1日適用

I 1時間あたりの使用料

単位:円、消費税込み

番号	共用機器種別	データ登録	依頼測定時(技術代行)			直接測定時(技術補助)			直接測定時			(参考) 旧ナノテクノロジー機器 No.
			学内者	学外者		学内者	学外者		学内者	学外者		
				非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人	
NU-221	プラズマCVD装置	未登録	1,600	6,500	8,000	1,600	4,300	5,500	1,600	2,500	3,500	62
	サムコ製 PD-240	登録		4,600	5,600		3,100	3,900		1,800	2,500	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,900	9,700	---	5,200	6,600	---	3,000	4,200	
NU-222	レーザー描画装置	未登録	1,500	6,200	7,600	1,500	4,000	5,100	1,500	2,200	3,100	22
	Heidelberg Instruments社製 DWL66FS	登録		4,400	5,400		2,800	3,600		1,600	2,200	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	8,200	9,900	---	5,500	6,800	---	3,300	4,400	
NU-223	フォトリソグラフィ装置	未登録	1,100	5,900	7,300	1,100	3,700	4,800	1,100	1,900	2,800	23
	ウシオ電機社製 マルチライトML251A/B、共和理研社製 スピンナーK-359SD-1	登録		4,200	5,200		2,600	3,400		1,400	2,000	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,500	9,200	---	4,800	6,100	---	2,600	3,700	
NU-224	電子ビーム蒸着装置	未登録	1,500	6,200	7,500	1,500	4,000	5,000	1,500	2,200	3,000	25
	アルバック社製 EBX-10D	登録		4,400	5,300		2,800	3,500		1,600	2,100	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,900	9,500	---	5,200	6,400	---	3,000	4,000	
NU-225	ICPエッチング装置	未登録	2,100	7,000	8,400	2,100	4,800	5,900	2,100	3,000	3,900	27
	アルバック社製 CE-300I		(25,600)	(80,300)	(94,100)	(25,600)	(55,700)	(66,300)	(25,600)	(36,100)	(44,100)	
	()内は1回あたりの料金 ※試料を高真空中に保持し作製(約8時間)する場合	登録		4,900	5,900		3,400	4,200		2,100	2,800	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	9,300	11,100	---	6,600	8,000	---	4,400	5,600	
NU-226	RIEエッチング装置	未登録	1,300	6,000	7,000	1,300	3,800	4,500	1,300	2,000	2,500	28
	サムコ社製 RIE-10NR	登録		4,200	4,900		2,700	3,200		1,400	1,800	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,900	9,200	---	5,200	6,100	---	3,000	3,700	
	走査型電子顕微鏡	未登録	1,800	6,600	8,100	1,800	4,400	5,600	1,800	2,600	3,600	
NU-227	日立ハイテクフィールドインテック社製 S5200	登録		4,700	5,700		3,100	4,000		1,900	2,600	29
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	9,000	10,900	---	6,300	7,800	---	4,100	5,400	
	走査型電子顕微鏡	未登録	2,000	6,900	8,200	2,000	4,700	5,700	2,000	2,900	3,700	
NU-228	日立ハイテクフィールドインテック社製S4300	登録		4,900	5,800		3,300	4,000		2,100	2,600	74
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	8,400	10,000	---	5,700	6,900	---	3,500	4,500	
	スハツタ絶縁膜作製装置	未登録	1,500	6,300	7,600	1,500	4,100	5,100	1,500	2,300	3,100	
NU-229	MESA77社製 AFTEX-3420	登録		4,500	5,400		2,900	3,600		1,700	2,200	26
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,700	9,200	---	5,000	6,100	---	2,800	3,700	
	マスクレス露光装置	未登録	1,600	6,700	8,000	1,600	4,500	5,500	1,600	2,700	3,500	
NU-231	ナノシステムソリューションズ製 DL-1000	登録		4,700	5,600		3,200	3,900		1,900	2,500	78
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	8,200	9,700	---	5,500	6,600	---	3,300	4,200	
	原子層堆積装置	未登録	4,100	9,500	11,300	4,100	7,300	8,800	4,100	5,500	6,800	
NU-232	サムコ製 AD-100LE	登録		6,700	8,000		5,200	6,200		3,900	4,800	79
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	11,600	13,700	---	8,900	10,600	---	6,700	8,200	
	蛍光りん光分光光度計	未登録	200	5,200	6,100	200	3,000	3,600	200	1,200	1,600	
NU-233	堀場製作所製 Fluoromax-4P	登録		3,700	4,300		2,100	2,600		900	1,200	80
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	6,400	7,400	---	3,700	4,300	---	1,500	1,900	
	ICPエッチング装置	未登録	2,900	8,000	9,600	2,900	5,800	7,100	2,900	4,000	5,100	
NU-234	サムコ社製 RIE-200iPN	登録		5,600	6,800		4,100	5,000		2,800	3,600	83
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	9,800	11,700	---	7,100	8,600	---	4,900	6,200	
	超高密度大気圧プラズマ装置	未登録	700	5,400	6,300	700	3,200	3,800	700	1,400	1,800	
NU-235	富士機械製造(株)社製	登録		3,800	4,500		2,300	2,700		1,000	1,300	31
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,100	8,200	---	4,400	5,100	---	2,200	2,700	
	In-situ 電子スピン共鳴(ESR)	未登録	2,000	6,900	8,000	2,000	4,700	5,500	2,000	2,900	3,500	
NU-236	Bruker社製 EMX Premium X	登録		4,900	5,600		3,300	3,900		2,100	2,500	35
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	9,200	10,500	---	6,500	7,400	---	4,300	5,000	
	ラジカル計測付多目的プラズマプロセス装置	未登録	1,800	6,600	8,000	1,800	4,400	5,500	1,800	2,600	3,500	
NU-237		登録		4,700	5,600		3,100	3,900		1,900	2,500	38
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	9,400	11,300	---	6,700	8,200	---	4,500	5,800	

マテリアル先端リサーチインフラ (ARIM) 事業共用機器の使用料設定について
(旧ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細加工)分)

令和6年5月1日適用

I 1時間あたりの使用料

単位:円、消費税込み

番号	共用機器種別	データ登録	依頼測定時(技術代行)			直接測定時(技術補助)			直接測定時			(参考) 旧ナノテクノロジー機器 No.
			学内者	学外者		学内者	学外者		学内者	学外者		
				非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人	
NU-238	高温プロセス用誘導結合型プラズマエッチング装置	未登録	2,800	7,800	9,100	2,800	5,600	6,600	2,800	3,800	4,600	66
	NUシステム製 NU-RC/CI-Etch	登録		5,500	6,400		4,000	4,700		2,700	3,300	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	11,200	13,000	---	8,500	9,900	---	6,300	7,500	
NU-239	表面解析プラズマビーム装置	未登録	3,700	8,800	11,700	3,700	6,600	9,200	3,700	4,800	7,200	67
	NUシステム製 LIA-Plasma Beam/CF&Cl System	登録		6,200	8,200		4,700	6,500		3,400	5,100	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	13,900	17,800	---	11,200	14,700	---	9,000	12,300	
NU-240	in-situプラズマ照射表面分析装置	未登録	2,900	7,900	9,900	2,900	5,700	7,400	2,900	3,900	5,400	68
		登録		5,600	7,000		4,000	5,200		2,800	3,800	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	12,400	15,100	---	9,700	12,000	---	7,500	9,600	
NU-241	超高密度液中プラズマ装置	未登録	1,100	5,900	6,700	1,100	3,700	4,200	1,100	1,900	2,200	32
	NUシステム社製	登録		4,200	4,700		2,600	3,000		1,400	1,600	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,200	8,200	---	4,500	5,100	---	2,300	2,700	
NU-242	大気圧IAMS(イオン付着質量分析器)	未登録	1,800	6,700	7,700	1,800	4,500	5,200	1,800	2,700	3,200	33
	キャンアネルバ社製	登録		4,700	5,400		3,200	3,700		1,900	2,300	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	8,200	9,400	---	5,500	6,300	---	3,300	3,900	
NU-243	真空紫外吸収分光計(原子ラジカルモニター)	未登録	2,900	7,900	9,100	2,900	5,700	6,600	2,900	3,900	4,600	34
	NUシステム社製	登録		5,600	6,400		4,000	4,700		2,800	3,300	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	9,600	11,100	---	6,900	8,000	---	4,700	5,600	
NU-244	レーザ描画装置一式	未登録	3,100	8,300	9,700	3,100	6,100	7,200	3,100	4,300	5,200	43
	Heidelberg製 mPG101-UV	登録		5,900	6,800		4,300	5,100		3,100	3,700	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	11,900	13,800	---	9,200	10,700	---	7,000	8,300	
NU-245	スパッタリング装置一式	未登録	4,000	9,300	10,900	4,000	7,100	8,400	4,000	5,300	6,400	44
	キャンアネルバ製 E-200S	登録		6,600	7,700		5,000	5,900		3,800	4,500	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	13,600	15,800	---	10,900	12,700	---	8,700	10,300	
NU-246(1)	3次元レーザ・リソグラフィシステム一式	未登録	2,600	7,700	9,300	2,600	5,500	6,800	2,600	3,700	4,800	45(1)
	(1)Nanoscribe製 フォトリソグラフィシステム	登録		5,400	6,600		3,900	4,800		2,600	3,400	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	10,700	13,000	---	8,000	9,900	---	5,800	7,500	
NU-246(2)	3次元レーザ・リソグラフィシステム一式	未登録	700	5,500	6,500	700	3,300	4,000	700	1,500	2,000	45(2)
	(2)KISCO製 SCLEAD3CD2000	登録		3,900	4,600		2,400	2,800		1,100	1,400	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,100	8,400	---	4,400	5,300	---	2,200	2,900	
NU-247	ナノインプリント装置一式	未登録	1,700	6,900	8,300	1,700	4,700	5,800	1,700	2,900	3,800	47
	SCIVAX製 X-300 BVU-ND	登録		4,900	5,900		3,300	4,100		2,100	2,700	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	8,900	10,700	---	6,200	7,600	---	4,000	5,200	
NU-248	パリレンコーティング装置一式	未登録	400	5,300	6,300	400	3,100	3,800	400	1,300	1,800	48
	KISCO製 DACS-LAB	登録		3,800	4,500		2,200	2,700		1,000	1,300	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	6,500	7,700	---	3,800	4,600	---	1,600	2,200	
NU-249	高精度電子線描画装置一式	未登録	5,300	11,000	12,800	5,300	8,800	10,300	5,300	7,000	8,300	54
	日本電子機製 SPG-724	登録		7,700	9,000		6,200	7,300		4,900	5,900	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	13,400	15,500	---	10,700	12,400	---	8,500	10,000	
NU-250	マスクライナー一式	未登録	1,200	6,400	7,500	1,200	4,200	5,000	1,200	2,400	3,000	41(2)
	(2)Suss MicroTec AG製 MJB-3	登録		4,500	5,300		3,000	3,500		1,700	2,100	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,800	9,100	---	5,100	6,000	---	2,900	3,600	
NU-251	マスクライナー一式	未登録	1,100	6,300	7,400	1,100	4,100	4,900	1,100	2,300	2,900	41(3)
	(3)ナノテック製 LA410	登録		4,500	5,200		2,900	3,500		1,700	2,100	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,700	9,000	---	5,000	5,900	---	2,800	3,500	
NU-252	蛍光バイオイメージング装置一式	未登録	1,100	5,900	7,200	1,100	3,700	4,700	1,100	1,900	2,700	50
	共焦点レーザ顕微鏡システム ニコン製 A1Rsi-N	登録		4,200	5,100		2,600	3,300		1,400	1,900	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,200	8,800	---	4,500	5,700	---	2,300	3,300	
NU-253	SEM用断面試料作製装置	未登録	700	5,700	6,500	700	3,500	4,000	700	1,700	2,000	55
	JEOL製 SM-09010	登録		4,000	4,600		2,500	2,800		1,200	1,400	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,000	7,900	---	4,300	4,800	---	2,100	2,400	

マテリアル先端リサーチインフラ (ARIM) 事業共用機器の使用料設定について
(旧ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細加工)分)

令和6年5月1日適用

I 1時間あたりの使用料

単位:円、消費税込み

番号	共用機器種別	データ登録	依頼測定時(技術代行)			直接測定時(技術補助)			直接測定時			(参考) 旧ナノテクノロジー機器 No.
			学内者	学外者		学内者	学外者		学内者	学外者		
				非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人	
NU-254	デジタルマイクロスコープ式	未登録	1,000	5,900	6,900	1,000	3,700	4,400	1,000	1,900	2,400	56
	KEYENCE製 VK-9700	登録		4,200	4,900		2,600	3,100		1,400	1,700	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,200	8,400	---	4,500	5,300	---	2,300	2,900	
NU-255	デジタルマイクロスコープ式	未登録	800	5,500	6,400	800	3,300	3,900	800	1,500	1,900	71
	KEYENCE製 VK-9510	登録		3,900	4,500		2,400	2,800		1,100	1,400	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	6,700	7,800	---	4,000	4,700	---	1,800	2,300	
NU-256	Deep Si Etcher	未登録	8,800	14,900	17,700	8,800	12,700	15,200	8,800	10,900	13,200	73
	住友精密工業製 Multiplex-ASE	登録		10,500	12,400		8,900	10,700		7,700	9,300	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	18,100	21,500	---	15,400	18,400	---	13,200	16,000	
NU-257	露光プロセス装置一式	未登録	700	5,500	6,600	700	3,300	4,100	700	1,500	2,100	17
	ユニオン光学社製 PEM800	登録		3,900	4,700		2,400	2,900		1,100	1,500	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	6,700	8,000	---	4,000	4,900	---	1,800	2,500	
NU-258	フーリエ変換赤外分光分析装置	未登録	1,100	5,900	7,100	1,100	3,700	4,600	1,100	1,900	2,600	60
	日本分光社製 FT/IR-615V型	登録		4,200	5,000		2,600	3,300		1,400	1,900	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,200	8,600	---	4,500	5,500	---	2,300	3,100	
NU-259(1)	磁気特性評価システム	未登録	1,200	6,000	7,100	1,200	3,800	4,600	1,200	2,000	2,600	40(1)
	(1)交番磁界勾配型磁力計	登録		4,200	5,000		2,700	3,300		1,400	1,900	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,300	8,600	---	4,600	5,500	---	2,400	3,100	
NU-259(2)	磁気特性評価システム	未登録	1,300	6,300	7,500	1,300	4,000	4,900	1,300	2,200	2,900	40(2)
	(5)振動試料型磁力計 TM-VSM271483-HGC	登録		4,500	5,300		2,800	3,500		1,600	2,100	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,600	9,000	---	4,900	6,000	---	2,700	3,500	
NU-259(3)	磁気特性評価システム	未登録	1,000	5,800	6,800	1,000	3,600	4,300	1,000	1,800	2,300	40(3)
	(3)トルク磁力計	登録		4,100	4,800		2,600	3,100		1,300	1,700	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,100	8,300	---	4,400	5,200	---	2,200	2,800	
NU-259(4)	磁気特性評価システム	未登録	1,100	5,900	7,100	1,100	3,700	4,600	1,100	1,900	2,600	40(4)
	(4)磁気光学スペクトロメータ	登録		4,200	5,000		2,600	3,300		1,400	1,900	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,200	8,600	---	4,500	5,500	---	2,300	3,100	
NU-260	マスク露光装置	未登録	1,300	6,300	7,200	1,300	4,000	4,700	1,300	2,200	2,700	
	ネオアーク製 PALET DDB-701-DL4	登録		4,500	5,100		2,800	3,300		1,600	1,900	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,600	8,800	---	4,900	5,700	---	2,700	3,300	
NU-261	段差計	未登録	1,000	5,900	6,800	1,000	3,600	4,300	1,000	1,800	2,300	
	小坂研究所製 ET200A	登録		4,200	4,800		2,600	3,100		1,300	1,700	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	7,100	8,300	---	4,400	5,200	---	2,200	2,800	
NU-262	プラズマ誘起CVD装置	未登録	4,200	9,700	11,300	4,200	7,400	8,700	4,200	5,600	6,700	
	サムコ社製 PD-220N	登録		6,800	8,000		5,200	6,100		4,200	4,700	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	11,700	13,600	---	9,000	10,600	---	6,800	8,100	
NU-263	高分解能走査型電子顕微鏡	未登録	1,500	6,400	7,700	1,500	4,100	5,100	1,500	2,300	3,100	
	日本電子製 JSM-IT800SHL	登録		4,500	5,400		2,900	3,600		1,700	2,200	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	9,000	10,800	---	6,300	7,800	---	4,100	5,300	
NU-264	原子間力顕微鏡	未登録	1,300	6,200	7,300	1,300	3,900	4,700	1,300	2,100	2,700	
	パーク・システムズ社製 NX20	登録		4,400	5,200		2,800	3,300		1,500	1,900	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	8,800	10,300	---	6,100	7,300	---	3,900	4,800	
NU-265	物理特性測定装置	未登録	2,300	7,300	8,700	2,300	5,000	6,100	2,300	3,200	4,100	
	日本カンタム・デザイン社製 DynaCool-12T	登録		5,200	6,100		3,500	4,300		2,300	2,900	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	10,200	12,000	---	7,500	9,000	---	5,300	6,500	
NU-266	全自動X線回折装置	未登録	1,700	6,700	8,000	1,700	4,400	5,400	1,700	2,600	3,400	
	リガク製 SmartLab 9kW	登録		4,700	5,600		3,100	3,800		1,900	2,400	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	9,300	10,900	---	6,600	7,900	---	4,400	5,400	
NU-267	RIEエッチング装置	未登録	1,900	6,900	8,100	1,900	4,600	5,500	1,900	2,800	3,500	
	サムコ社製 RIE-10NR	登録		4,900	5,700		3,300	3,900		2,000	2,500	
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	9,300	10,800	---	6,600	7,800	---	4,400	5,300	

マテリアル先端リサーチインフラ (ARIM) 事業共用機器の使用料設定について
(旧ナノテクノロジープラットフォーム事業 (微細加工) 分)

令和6年5月1日適用

I 1時間あたりの使用料

単位:円、消費税込み

番号	共用機器種別	データ登録	依頼測定時(技術代行)			直接測定時(技術補助)			直接測定時		
			学内者	学外者		学内者	学外者		学内者	学外者	
				非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人
NU-268	電子線描画用データ処理ソフトウェア	未登録	1,700	6,700	7,700	1,700	4,400	5,100	1,700	2,600	3,100
	GenISys社製 BEAMER	登録		4,700	5,400		3,100	3,600		1,900	2,200
	(オプション)研究成果非公開使用料		---	8,100	9,200	---	5,400	6,200	---	3,200	3,700

(参考)
旧ナノテクノロジー機器
No.

★研究成果非公開使用料は、共用機器1時間あたりのオプション料金であり、別途加算する。

☆上記共用機器使用料は、文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」の採択により軽減されております。

事業終了後は、通常の料金設定となります。

II 算出内訳 別紙1のとおり

III 項目別算出基礎 別紙2のとおり

IV 解析手数料(1時間当たり)

単位:円、消費税込み

解析手数料	学内者	学外者	
		非営利法人	営利法人
		5,900	6,600

V 算出基礎 別紙3のとおり